

# FIB-SEM 複合装置による 断面加工・観察・分析

おすすめ技術分野 測定計測「先端機器分析」

日時 2023年8月29日(火) 10:00~16:00

場所 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(本部)

東京都江東区青海 2-4-10

●ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前

●りんかい線「東京レポート」駅下車 徒歩 15分 [朝夕無料送迎バスあり]

都営バス海01 テレコムセンター駅前下車

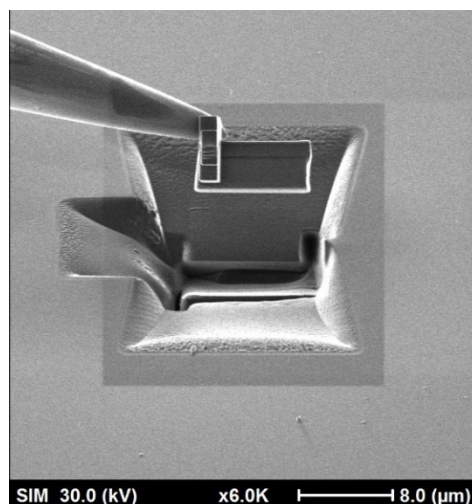
受講料 5,000円

集束イオンビーム(FIB\*)と走査電子顕微鏡(SEM\*\*)を組み合わせたFIB-SEM複合装置は、機械研磨では難しいミクロンサイズの微小領域を断面加工・観察・分析できます。表面処理品や半導体部品の内部構造や欠陥を評価可能ですが、一般的なSEMなどと比べると馴染みが薄く、試験を検討する際に敷居がやや高い面があるのが実情です。

本セミナーでは、FIB-SEM複合装置について、座学で基礎を学んだ後、実験室に移動し実際の装置で加工・観察の様子をご覧ください。試験を検討中の方、また、一から学びたいという方を対象に、今後の助けとなる内容となります。

FIB\*: Focused Ion Beam の略

SEM\*\*: Scanning Electron Microscope の略



FIB-SEM 複合装置による微小領域のサンプリングの様子



マスコットキャラクター チリン®

定員

4名

詳細は裏面またはこちら



## 講座内容・スケジュール

時間	科目	講師
10:00～11:30	【講義】イオンビームによる断面加工・観察・分析 【第一部】 FIB-SEM	株式会社日立ハイテク 解析企画部 和田 博之、陳 ヤオ 解析システム四部 高木 幸太
11:30～12:30	休憩	
12:30～14:00	【講義】イオンビームによる断面加工・観察・分析 【第二部】 関連機器	
14:00～16:00	【デモ】FIB-SEMによる断面加工・観察・分析	東京都立産業技術研究センター 小川 大輔 計測分析技術グループ副主任研究員 金属酸化物材料の研究・開発に従事 東京都立産業技術研究センター 杉森 博和 計測分析技術グループ副主任研究員 金属材料分析、金属腐食の解析に従事

## 開催要項

- <応募資格> 原則として、日本の法人の従業員、個人事業主または創業を予定している個人
- <申込締切> 2023年8月17日（木） ※定員を超えた場合は期日前に締め切ることがあります。
- <申込方法> 都産技研ウェブサイト(<https://www.iri-tokyo.jp/seminar/230829.html>)の Web 申込フォームからお申し込みください。

## ●申込時には、

「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター技術支援事業ご利用約款  
第1章 総論および第7章 技術セミナー・講習会オンラインでの開催」  
(<https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/15390.pdf>)の  
条文についてご承諾の上お申し込みをお願いします。



- <受講可否> 受講予定者には受講料払込書を郵送します。  
定員などの関係で受講をお断りする場合は、電話・電子メールなどにてご連絡します。
- <問合せ先> 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術振興室 技術セミナー係  
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10  
TEL:03-5530-2308 FAX:03-5530-2318 e-mail : [kenshu@iri-tokyo.jp](mailto:kenshu@iri-tokyo.jp)

